

レジストとリソグラフィの 基礎とトラブル解決策

1名分料金で
2人目無料

- ◆日時: 2018年10月31日(水) 10:30~16:30
 - ◆会場: 商工情報センター(カメリアプラザ) 9F 会議室
 - ◆聴講料: 1名につき49,980円(税込、昼食・資料付)
- ※会員登録(無料)をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。
- ・1名でお申込みされた場合、1名につき**47,250円**
 - ・2名同時でお申し込みされた場合、**2人目は無料(2名で49,980円)**
- ※学生のご参加は、1名につき受講料10,800円です。
(ただし、企業在籍者は除きます。また、2人目無料も適用外です。)

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師: 富山県立大学 工学部 機械システム工学科 客員教授 工学博士 花畑 誠 氏

《受講対象・レベル》

- (1) レジスト材料の研究開発、製造、品質管理、販売
 - (2) 半導体、ディスプレイ、MEMS、センサーなどのデバイス開発、製造、販売
- 上記に従事されている方々およびリーダークラスの方々

《習得できる知識》

- ・レジストを製造するための基礎知識、設計概念と具体的方法
- ・レジストを使用する際の留意事項、トラブル対応能力
- ・リソグラフィー使用現場におけるトラブル対応能力
- ・レジストの品質管理手法
- ・リソグラフィープロセスの最適化方法
- ・素材メーカー、レジストメーカーとしての顧客対応能力

《プログラム》

1. リソグラフィの基礎
 - (1) リソグラフィーとは
 - (2) 露光システムとリソグラフィー装置の変遷
2. レジスト材料とその高性能化
 - (1) パターンニング用レジスト材料(総論)
 - (2) G線、i線用レジスト
 - (3) KrF用レジスト
 - (4) ArFおよびArF液浸用レジスト
 - (5) EUV用レジスト
3. レジスト製造技術と品質管理
 - (1) レジスト製造技術
 - (2) レジストの性能安定化技術
 - (3) 品質管理—その項目と方法
4. レジスト材料の評価技術
 - (1) 性能評価
 - (2) 品質評価
 - (3) シミュレーション技術
5. レジスト製造、および使用現場におけるトラブル対応
 - (1) 種々のトラブルとその解決策(材料面から)
 - (2) 種々のトラブルとその解決策(プロセス面から)
 - (3) 顧客対応の方法
6. 20nm以下のリソグラフィー技術
 - (1) ダブルパターンニング技術
 - (2) DSA技術とその材料
 - (3) ナノインプリント技術
 - (4) 今後のリソグラフィー技術

【質疑応答・名刺交換】

『レジスト』セミナー申込書

FAX: 03-5857-4812

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。

Eメール 郵送

● セミナーの受講申込みについて ●

左の申込みフォームに必要事項をご明記の上、FAXしてください。お申込み後は、弊社より確認のご連絡をいたしまして受講券、請求書、会場の地図をお送りいたします。
セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>